

DIN EN ISO 25178-603:2014-02 (D)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Flächenhaft - Teil 603: Merkmale von berührungslos messenden Geräten (phasenschiebende interferometrische Mikroskopie) (ISO 25178-603:2013); Deutsche Fassung EN ISO 25178-603:2013

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Begriffe	5
2.1 Begriffe, die sich auf alle flächenhaften Verfahren zur Messung der Oberflächenbeschaffenheit beziehen.....	5
2.2 Begriffe, die sich auf x - und y -Abtastsysteme beziehen	12
2.3 Begriffe, die sich auf optische Systeme beziehen.....	14
2.4 Begriffe, die sich auf die optischen Eigenschaften des Werkstücks beziehen.....	16
2.5 Spezifische Begriffe zur phasenverschiebenden interferometrischen Mikroskopie	17
3 Beschreibung der Einflussgrößen.....	18
3.1 Allgemeines	18
3.2 Einflussgrößen	19
Anhang A (informativ) Bestandteile eines phasenschiebenden interferometrischen (PSI-) Mikroskops.....	21
Anhang B (informativ) Phasenschiebende interferometrische (PSI-) Mikroskopie — Theorie der Arbeitsweise	22
Anhang C (informativ) Messabweichungen und Korrekturen phasenverschiebender interferometrischer (PSI-) Mikroskope	27
Anhang D (informativ) Zusammenhänge mit dem GPS-Matrix-Modell.....	30
Literaturhinweise	31